

Dielektrik Resonatör Mikrostrip Bağlaşımlarında Sıcaklık Katsayısı Ölçümleri

Emine Yeşim Yüksel

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Tınaztepe İzmir

E-mail: eyesim.yusel@deu.edu.tr

Özet

Dielektrik resonatörler günümüzde mikrodalga osilatörlerinde, frekans ayırtaclarında işaret kaynağı olarak geniş kullanım alanı bulmaktadır. Dielektrik resonatör kullanarak kısa dönem kararlılığı yüksek işaret kaynakları elde edilebilir. Diğer yandan sistemlerin uzun dönemli kararlılıklarını materyal yaşlanması, sıcaklık ve nem gibi diğer bazı faktörlere bağlıdır. Dielektrik resonatörler osilator frekanslarının kararlılığının artırılmasında önemli rol oynamaktadır ve dielektrik resonatör devrelerinin duyarlılığının artırılması osilatör devrelerinin de kararlılıklarını artırmaktadır. Dielektrik resonatörler mikrodalga entegre devrelerinde mikrostrip hatlarla bağlantılı olarak kullanıldığından, maliyet ve devrenin fiziksel boyutları açısından önemli ölçütlere azalma sağlanmaktadır. Bu nedenlerle de her geçen gün daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışma dielektrik resonatör microstrip bağlaşımlarının sıcaklık kararlılık katsayılarının ölçümlerinin deneysel sonuçlarını ve analitik metodlarla yapılan karşılaştırmalarını içermektedir.

Anahtar Kelimeler

Dielektrik resonatör, Sıcaklık katsayısı

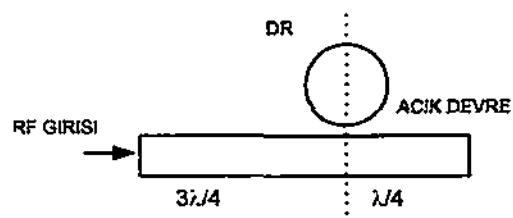
Giriş

Dielektrik resonatörler üzerine yapılan ilk çalışmalar 1930 yılının sonlarında başlamakla beraber pratik alandaki uygulamaları 1960'lı yılları bulmuştur. Son günlerde özellikle mikrodalga filtre ve osilatör devrelerinde dielektrik resonatörler sık kullanılan elementler durumuna gelmiştir. Dielektrik resonatör ve mikrostrip kombinasyonu teknolojisi özellikle osilatör ve frekans ayırtac devrelerinin kararlılığının artırılmasında geniş uygulama alanları bulunmaktadır. Seramik malzemelerin üretimindeki gelişmeler sayesinde günümüzde mikrodalga frekanslarında çalışan resonans frekans sıcaklık katsayı kontrol edilebilen, düşük dielektrik kayıplı dielektrik resonatörler bulmak mümkün olmaktadır. Kullanım alanına göre dielektrik resonatörlerin malzeme özelliklerinin özellikle de resonans

frekansının sıcaklıkla değişiminin bilinmesi gereklidir. Dielektrik resonatörlerin dielektrik sabiti, fiziksel boyutları ve dolaylı olarak resonans frekansları sıcaklık değişimi ile artış veya azalış gösterir. Dielektrik resonatör üreticileri genellikle dielektrik malzemenin genleşme katsayısı α ve resonans frekansı sıcaklık katsayısının (τ_f) değerini izole edilmiş dielektrik resonatörler için verirler. Bununla beraber dielektrik resonatörler pratik uygulamalarda genelde mikrostrip hatlarla bağlantılı şekilde kullanılır. Bu sebeple resonans frekansı sıcaklık katsayısının kullanıcı tarafından ölçülmesi gereklidir.

Deney Düzeneği

Resonans frekansı sıcaklık katsayıları ölçümleri için Şekil 1'de gösterilen dielektrik resonatör, mikrostrip bağlaşımlı kullanıldı. Mikrostrip hat altyapı malzemesi olarak Duroid RT5880 ve dielektrik resonatör olarak da Trans-Tech firması tarafından üretilen silindirik tipte Tablo 1'de gösterilen üç farklı dielektrik resonatör kullanıldı. Bu dielektrik resonatörlerin her birinin resonans



Şekil 1. Test devresi

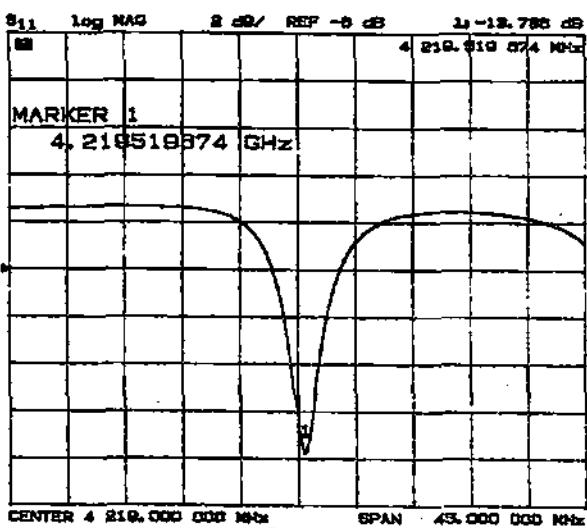
frekansları 4 GHz civarında olup, buna karşın farklı resonans frekansı sıcaklık katsayılarına sahiptirler. Dielektrik resonatörlerin bu şekilde seçilmelerinin nedeni kurulan test devresinde dielektrik resonatörün bütün resonans sistemi frekans kararlılığına olan etkilerini gözlemlemektir. Kullanılan resonatörlerin genleşme katsayıları üretici firma tarafından verilmiştir ve bu katsayı ilk iki resonatör için $6.5 \text{ ppm}^{\circ}\text{C}$ ve üçüncü tip dielektrik resonatör için $10 \text{ ppm}^{\circ}\text{C}$ olarak verilmiştir.

Tabelo 1.

Ölçümlerde kullanılan dielectric resonatörler

DR Tipi	Üreticinin tanımladığı τ_{ppm} (ppm/ $^{\circ}\text{C}$)	Dielektrik sabiti	Çap (mm)	Kalınlık (mm)
DR1	+9.30	36.93	12.82	7.03
DR2	-4.10	36.26	13.84	6.22
DR3	-0.50	36.03	13.84	6.22

Hazırlanan devre 0-60 $^{\circ}\text{C}$ arasında test edildi. Oda sıcaklığı-60 $^{\circ}\text{C}$ arası ölçümler için devre bir firma yerleştirildi. Oda sıcaklığı altındaki ölçümler için de katıhal diot dizilerinden oluşan bir termoelektrik bir soğutucu kullanıldı. Resonans frekansı yansıma katsayısı ($|S_{11}|$) büyülüklüğü gözlemlenerek ölçüldü. $|S_{11}|$ deki sıcaklık değişimini takip eden frekans kaymaları kayıt edildi. Şekil 2 HP Network Analyzer kullanılarak, oda sıcaklığındaki yansıma katsayısı ölçümünü göstermektedir.



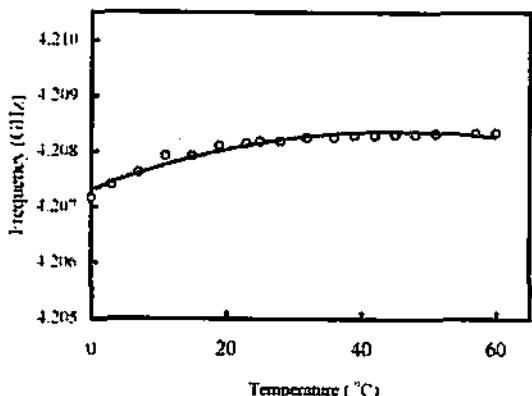
Şekil 2. DR1 için $|S_{11}|$ ölçümü

Test edilen devrelerde ilk olarak oda sıcaklığında sistemin resonans frekansı (f_0) daha sonra her 4 $^{\circ}\text{C}$ sıcaklık aralıkları ile 0-60 $^{\circ}\text{C}$ arasında resonans frekansı sapmaları gözlemlendi. Elde edilen sonuçlar eşitlik (1) kullanılarak resonans frekansı sıcaklık katsayısi (τ_f) ppm/ $^{\circ}\text{C}$ (part per million per centigrade degree) hesaplandı.

$$\tau_f = \frac{\Delta f(\text{MHz})}{f_0(\text{MHz})} \frac{1}{\Delta T} \quad (1)$$

Bulunan sonuçlar Tablo 2'nin ilk kolonunda gösterilmiştir. Herbir dielektrik resonatör için aynı

ölçümler tekrar edildi. Şekil 3'de DR1 için deneyel olarak elde edilen sonuçların grafik gösterimi sunulmuştur.



Şekil 3 DR1. Mikrostrip bağlamında resonans frekansının sıcaklıkla değişimi

Karşılaştırmalar

Dielektrik mikrostrip bağışmlarından oluşan resonant sistemlerinde resonans frekansının sıcaklıkla yaptığı salınımın bu sistemi oluşturan dielektrik resonatör, altyapı malzemesi gibi değişik kısımların fiziksel ve materyal parametrelerinin sıcaklıkla değişiminin toplam bir sonucu olarak düşünülebilir. Ölçüm sonuçlarının teorik verilerle uyumluluğunu karşılaştırmak için Higashi ve Makino [7] tarafından geliştirilen eşitlik 2'de gösterilen analitik formül kullanıldı. Bu eşitlik dielektrik resonatör, bir dielektrik alt yapı malzemesi üzerine konduğu zaman resonans frekansı sıcaklık katsayısının ölçümüne yarar.

$$\begin{aligned} \tau_f = & C_D \alpha_D + C_L \alpha_L + C_{h1} \alpha_{h1} + C_{h2} \alpha_{h2} + C_{\epsilon_1} \tau_{\epsilon_1} \\ & + C_{\epsilon_2} \tau_{\epsilon_2} + C_{\epsilon_r} \tau_{\epsilon_r} \end{aligned} \quad (2)$$

Eşitlikteki τ_{ϵ_r} , resonatörün dielektrik sabitinin sıcaklık katsayısidır. Dielektrik resonatörün genleşme katsayıısı α_D ve α_L olarak gösterilmiştir. α_{h1}, α_{h2} , altyapı malzemesinin sırasıyla genleşme ve dielektrik sabit sıcaklık katsayısidır. Alt indeskleri 1 olan parametrelere dielektrik resonatörle metal kutu arasında kalan hava dolu bölgeye ait katsayılardır. C harfi ile gösterilen katsayılar resonans sistemini fiziksel ve materyal özelliklerini kullanılarak test ettiğimiz tıç düzenek için ayrı ayrı hesaplanmış ve üretici firmaların göndermiş olduğu katalog değerler kullanılarak resonans frekansının sıcaklık katsayıları analitik olarak da hesaplanmıştır. Deneyel ölçüm sonuçları ve

analitik sonuçlar Tablo 2'de gösterilmiştir. Bu tablodan da görülebileceği gibi veriler arasındaki fark %2.2'den az olup, sonuçlar uyumludur.

Tablo 2.
Deneyel ve Analitik Sonuç Karşılaştırmaları

DR Tipi	Deneyel	Analitik τ_{sys}	
		τ_{sys} (ppm/°C)	sonuçları (ppm/°C)
D8517	+0.00079	-0.188	
D8516	-11.55	-12.449	
D8371	-10.72	-9.14	

Sonuç ve Öneriler

Deneyel ölçüm sonuçları ve analitik hesaplamalardan görülen şudur ki; dielektrik resonatör, mikrostrip bağlaşımlarından oluşan resonans sistemlerinde resonans frekansı kararlılığı büyük ölçüde dielektrik resonatör resonans frekansı kararlılığına bağlıdır. Bununla beraber altyapı malzemesinin materal ve fizikal özelliklerini de kararlılığı etkileyen parametrelerdir. Dielektrik resonatör, mikrostrip bağlaşımu mikrodalgaya devrelerinde kararlılığı artırıcı elemanlar olarak kullanılırken bu ayrıntılar gözönünde bulundurulmalıdır. Pratik uygulamalarda dielektrik resonatör seçilirken üreticinin sağlamış olduğu katalog değerinin izole edilmiş dielektrik resonatör için geçerli olduğu gözönünde bulundurulmalıdır. Aynı resonatörün mikrostrip bağlaşımlarında resonans frekansı kararlılığının değişeceği bilierek amaca uygun resonatör seçimi yapılmalıdır.

Kaynaklar

- [1] R.V. Pound, "Electronic frequency stabilization of microwave oscillators", *The Review of Scientific Instruments*, Vol. 17, No. 11, pp. 491-505, November 1946.
- [2] W.W. Hansen, "Ultra high frequency discriminator and apparatus," U.S. Patent 2,402,456, April 4, 1950.
- [3] B. Glance and W. W. Snell, "A discriminator stabilized microstrip oscillator," *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.* pp. 648-650, October 1976.
- [4] M. J. Bianchini, J. B. Cole, R. DiBiase, Z. Galani, R. W. Laton, and R. C. Waterman, "A single resonator GaAs FET oscillator with noise degeneration," *IEEE MTT-S Digest*, pp. 270-273, June 1984.

- [5] C. Tsironis, and V. Pauker, "Temperature stabilization of GaAs MESFET oscillators using dielectric resonators," *IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques*, Vol. MTT-31, No. 3, pp. 312-314, March 1983.
- [6] T. Otobe, Y. Komatsu, and Y. Murakami, "A low-drift oscillator stabilized by a highly sensitive discriminator," *Sony Research Center, Hodogaya-ku, Yokohama, Japan*, pp. 319-324, 1983.
- [7] T. Higashi, and T. Makino, "Resonant frequency stability of the dielectric resonator on a dielectric substrate," *IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques*, Vol. MTT-29, pp. 1048-1052, October 1981.
- [8] E. Yuksel, "Temperature compensation for frequency discriminators based on dielectric resonators," Ph.D. Dissertation, Illinois Institute of Technology, December 1999.
- [9] A. P. Mourachkine, and A. R. Barel, "Temperature dependence of the principal properties of dielectric resonators," *Microwave Journal*, pp. 220-223, April 1995.